

中央研究院關鍵議題研究中心科研採購申請書

請購標的品名	案名: 高真空熱蒸鍍鍍膜設備 (案號:114001022)		
採購標的之性質種類	☒ 財物(包含儀器設備、試劑耗材、財物購置、訂製、租賃、權利使用等..) ☐ 勞務(包含專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、維修、訓練、勞力等)		
規格及數量	1. 規格:詳如規格需求書 2. 履約期限: 決標次日起 <u>30</u> 日曆日。 3. 付款方式: ☒ 驗收合格後一次付款。 4. 保固期限: ☒ 自驗收合格之日起保固 <u>1</u> 年。 5. 交貨地點: 中央研究院南部院區 6. 本採購以 ☒ 內購 or ☐ 外購方式進行。		
預估經費來源	55EB1「淨零排放」基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃-次世代高效太陽能技術發展 / 05 購建固定資產		
預估金額	新台幣3,500,000整		
採購理由說明	鈣鈦礦主動層成分組成多元,需準確控制前驅物比例,乾式真空鍍膜較濕式溶液製程易於實現未來商業化之均勻性且覆蓋性佳的薄膜。此外,考量到疊層元件各層不同材料皆具其的特性,為避免各疊層材料共用製程腔體導致交叉污染或非預期的化學反應,需多個機台,以獨立製程腔體。		
逕行採購理由說明	。		
檢附文件	1.報價單、2.規格需求、3.其他 (專屬權利、獨家製造或供應、原採購案號)。		
以下欄位由承辦人員填寫			
採購方式	1. 辦理方式: ☐ 逕行採購、 ☒ 公告招標。 2. 議價方式: ☐ 由請購單位與廠商口頭議價、 ☒ 與廠商開會議價。 3. 是否訂定合約: ☒ 是、 ☐ 否。		
底價訂定	☒ 是,請購設施建議底價。 ☐ 其他: ☐ 否,小額採購(30萬元)得不訂底價。		
請購人	採購人員	會計人員	單位主管
			